

PATENTE EUROPEIA Nº 1275133

device and method for the etching of a substrate by means of an inductively coupled plasma

Síntese do Processo

Nº do Pedido	1931374
Data de Apresentação	17-03-2001
Data do Pedido	17-03-2001
Fase Actual	PATENTE-SEM EFEITO NACIONAL
Data de Início da Fase	28-11-2004
Data de Fim Previsto	---
Situação de Taxas	PAGAMENTO NÃO-APLICÁVEL
Data de Início da Sit.	15-10-2004
Data de Fim Previsto da Sit.	---
Taxas Pagas	0
Taxas Devidas	0
BPI 1ª Publicação	---
Data do Despacho	---
BPI do Despacho	---
Data de Início de Vigência	---
Data Limite de Vigência	---
Titulares	ROBERT BOSCH GMBH
Mandatário	---
Classificação Internacional	H01J 37/32 (2006.01)
Processo em Tribunal	NÃO
Tribunal	---
Data de Envio	---

Texto do Resumo

 Nota: Não existe texto do resumo.



Classificação Internacional

Classe	Nível	Categoria	Valor
H01J 37/32 (2006.01)	avanzado	primeira	inventiva
H01L 21/3065 (2006.01)	avanzado	outra	inventiva
H01L 21/02 (2006.01)	avanzado	outra	inventiva



Fases Jurídicas

Fase	Data de Início	Data de Fim Previsto	Data de Fim Efectiva	Boletim	Entidade
21000000 - pedido-aguarda publ. p/ope.	17/03/2001	15/01/2003	15/01/2003	---	---
21110000 - pedido-conf.protec.provisória	15/01/2003	---	28/11/2004	---	---
21899000 - arquivado-pte. sem efeitos	28/11/2004	---	---	---	---



Taxas Periódicas

Situações de Taxas

Situação	Data de Início	Data de Fim Previsto	Data de Fim Efectiva	Boletim
21T00000 - pagamento não-aplicável	15/10/2004	---	---	

 Nota: Não existem registos de taxas efectivamente pagas em PT.



Entidades Intervinentes

Entidade	Nome	Morada	Localidade	Intervenção	Data de Início	Data de Fim
140646	Robert Bosch Gmbh	Postffach 30 02 20	D-70442 Stuttgart - Alemanha	requerente / titular	17/03/2001	



Documentos Relacionados

 Nota: Não existem registos documentos relacionados.



Boletins Relacionados

 Nota: Não existem registos boletins relacionados.



Prioridades

Tipo	Data	País	Número
PRIORIDADE UNIONISTA	19-10-2000	ALEMANHA	10051831



Países Designados

País	Data de Designação	Data de Fim de Designação
Alemanha	17-03-2001	---
Bélgica	17-03-2001	---
Chipre	17-03-2001	---
Dinamarca	17-03-2001	---
Espanha	17-03-2001	---
Finlândia	17-03-2001	---
França	17-03-2001	---
Grécia	17-03-2001	---
Holanda (Países Baixos)	17-03-2001	---
Irlanda	17-03-2001	---
Itália	17-03-2001	---
Liechtenstein	17-03-2001	---
Luxemburgo	17-03-2001	---
Mónaco	17-03-2001	---
Portugal	17-03-2001	---
Reino Unido	17-03-2001	---
Suécia	17-03-2001	---
Suíça	17-03-2001	---
Áustria	17-03-2001	---

Epígrafe em Língua Estrangeira

GB DEVICE AND METHOD FOR THE ETCHING OF A SUBSTRATE BY MEANS OF AN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA

